EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

11082508

PUBLICATION DATE

26-03-99

APPLICATION DATE

09-09-97

APPLICATION NUMBER

09244393

APPLICANT: SEIKO INSTR INC;

INVENTOR:

ISHIDA TAKASHI;

INT.CL.

F16C 32/00 F16C 35/10 G11B 19/20

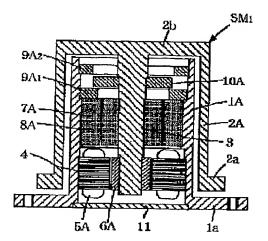
H02K 7/09 H02K 21/12

TITLE

SPINDLE DEVICE, SPINDLE MOTOR,

AND ROTARY DEVICE ADOPTING

SPINDLE MOTOR



ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a spindle device in which a gas thrust bearing is unnecessary, and a spindle can prevent the deflecting rotation of a shaft by rotating, decentrizing in the scope of a gap size of a gas radial bearing; a spindle motor furnishing a motor to the above spindle device; and a rotary body device applying the above spindle motor.

SOLUTION: When a radial bearing fixing member 7A is decenterized in a minute size, and an automatic core regulating operation to react the magnetic forces of ring magnets 9A1 and 9A2, and the magnetic force of a ring magnet 10A, to float a spindle 2A to a spindle support member 1A, so as to be going to fit the center of the ring magnet 10A to the center of the magnets 9A1 and 9A2, is generated, and the device is rotated, an air dynamic pressure is generated in a gap between the radial bearing member 7A and a radial bearing movable member 8A so as to release one side bearing, but the core deflecting condition is secured continuously, and the deflecting rotation of the spindle can be avoided, so as to reduce a nonrepeating rotation deflection (NRRO).

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-82508

(43)公開日 平成11年(1999) 3月26日

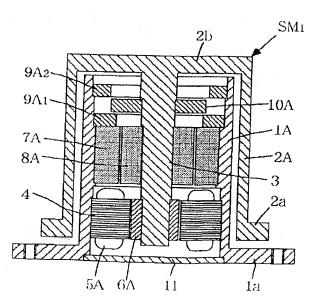
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FI
F 1 6 C 32/9		F 1 6 C 32/00 C
35/		35/10
G11B 19/2		G 1 1 B 19/20 E
H02K 7/0		H 0 2 K 7/09
21/1	12	21/12 M
-		審査請求 有 請求項の数5 OL (全 6 頁
(21)出願番号	特願平9-244393	(71) 出願人 000002325
(22) 出願日	平成9年(1997)9月9日	セイコーインスツルメンツ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地
		(72)発明者 大塚 校市
		千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セ
		イコーインスツルメンツ株式会社内
		(72) 発明者 石田 隆
		千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セ
	•	イコーインスツルメンツ株式会社内
		(74)代理人 弁理士 林 敬之助

(54) 【発明の名称】 スピンドル装置、スピンドルモータ及びスピンドルモータを採用した回転体装置

(57)【要約】

【課題】 気体スラスト軸受が不要でありスピンドルが 気体ラジアル軸受のギャップ寸法の範囲で偏芯して回転 し軸の振れ回りを防止できるスピンドル装置、及び前記 スピンドル装置にモータを備えたスピンドルモータ、及 び前記スピンドルモータを採用した回転体装置。

【解決手段】 ラジアル軸受固定部材7Aが微小寸法偏芯し、リング磁石9A1、9A2 の磁力とリング磁石1OAの磁力が反発し合ってスピンドル2Aをスピンドル支持部材1Aに対して浮かせてリング磁石9A1、9A2の中心にリング磁石1OAの中心を合わせようとする自動調芯作用を生起し、回転すると、ラジアル軸受固定部材7Aとラジアル軸受可動部材8Aの帯ャップ内にエア動圧が発生し、ラジアル軸受固定部材7Aとラジアル軸受可動部材8Aの間に動圧発生ギャップが生じて片当たりが解消するが引き続き偏芯状態が確保され、もってスピンドル2Aの振れ回りを回避でき非繰り返し回転振れ(NRRO)が減小する。



力とリング磁石9日の磁力が反発し合ってスピンドル2 Bをスピンドル支持部材1Bに対して浮かせてリング磁 石10B₁、10B₂の中心をリング磁石9Bの中心に 合わせようとする自動調芯作用力を生起し、この自動調 芯作用力がスピンドル2Bを偏心し、ラジアル軸受可動 部材8 Bとリング磁石10B₁、10B₂が一体に偏芯 する。従って、図4 (a)に示すように、モータ停止時 には、ラジアル軸受可動部材8Bがラジアル軸受固定部 材7日に対して偏芯移動してラジアル軸受可動部材8日 の内径がラジアル軸受固定部材7日の外径に片側で接し てラジアル軸受可動部材8Bの中心gがラジアル軸受固 定部材7Bの中心eに対して微小寸法、例えば約5~1 Oミクロンmmずれている。

【0016】好ましい実施の態様では、モータコイル5 Bの中心fは中心e-g間の略中間に位置している。図 4 (b) に誇張して示すように、モータ回転時には、ラ ジアル軸受可動部材8Bの中心gが移動してモータコイ ル5Bの中心fに一致する。これは、ラジアル軸受固定 部材7Bとラジアル軸受可動部材8Bのいずれかに設け られた動圧発生溝に取り込まれ昇圧する空気がラジアル 軸受固定部材7Bとラジアル軸受可動部材8Bの片当た りを解消するギャップ(例えばO. O1 mm)を生ぜし めて、該ギャップが生じる分だけラジアル軸受可動部材 8Bが移動してその中心gがモータコイル5Bの中心 f に一致するからである。従って、モータ回転時には、ス ピンドル2Bの回転中心がモータコイル5Bに対して同 芯状態に維持され、かつラジアル軸受可動部材8Bが片 側に偏芯してラジアル軸受固定部材7Bとの間に有効な 空気動圧を発生し、もってスピンドル2Bの振れ回りを 回避でき非繰り返し回転振れ (NRRO) が減少する。 【〇〇17】固定軸12に対して、ラジアル軸受固定部 材7Bを同芯とし、モータコイル5Bを微小寸法(例え ば5~10ミクロンmm) 偏芯させ、さらにリング磁石 9Bを同一方向に異なる微小寸法(例えば50~100 ミクロンmm)偏芯させることは高度の加工技術を必要 とし製作コストは高く付くので、固定軸12に対して、 ラジアル軸受固定部材7Bとモータコイル5Bを同芯と しても実用上差し支えない。

【0018】図5は、図3のスピンドルモータを採用し た回転体装置を示す。この回転体装置は、図3のスピン ドルモータSM2 のスピンドル2Bにポリゴンミラー1 3が被着され、ミラーケース 1 4 がスピンドルモータS M_2 のスピンドル支持部材 1 Bに支持されている構成で ある。図6は、図1のスピンドルモータSM₁を採用し た回転体装置を示す。この回転体装置は、ディスク装置 であり、本願第一の発明のスピンドルモータSMのスピ ンドルに、磁気ディスクまたは光ディスク等の被回転円

盤15を複数枚被着してなる。

【発明の効果】以上説明してきたように、本願発明のス ピンドル装置、及びスピンドルモータ、及びスピンドル モータを採用した回転体装置によれば、気体スラスト軸 受が不要でありスピンドルが気体ラジアル軸受のギャッ プ寸法の範囲で偏芯して回転し軸の振れ回り(ホワー ル)を回避でき非繰り返し回転振れ(NRRO)が減少 し安定した回転を確保できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本願第一の発明の第一の実施の態様に係るスピ ンドルモータの縦断面図。

【図2】(a)はモータ停止時の偏芯状態を示す説明図 であり、(b)はモータ回転時の偏芯状態を示す説明図

【図3】本願第一の発明の第一の実施の態様に係るスピ である。 ンドルモータの要部であるステータの形状と永久磁石と スピンドルの関係を示す水平断面図。

【図4】(a)はモータ停止時の偏芯状態を示す説明図 であり、(b)はモータ回転時の偏芯状態を示す説明図

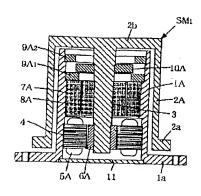
【図5】図3のスピンドルモータを採用した回転体装置

【図6】図1のスピンドルモータを採用した回転体装置 の断面図。 の断面図。

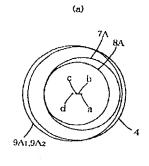
ľ	符号の説明	1

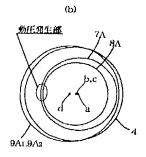
【符号の説明』	スピンドルモータ
SM_1	スピンドル支持部材
1 A	スピンドル
2 A	ステータ
4	モータコイル
5 A	モータ用永久磁石
6 A	ラジアル軸受固定部材
7 A	ラジアル軸受可動部材
8 A	リング磁石
$9A_1 \cdot 9A_2$	リング磁石
1 O A	スピンドルモータ
SM_2	スピンドル支持部材
1 B	スピンドル
2 B	モータコイル
5 B	モータ用永久磁石
6 B	ラジアル軸受固定部材
7 B	ラジアル軸受可動部材
8 B	リング磁石
9 B	NO NOTH TO
10B ₁ . 1	ポリゴンミラー-
13	被回転円盤
15	DX E-1701

【図1】



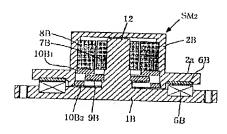
【図2】

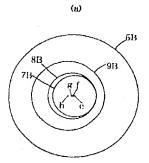


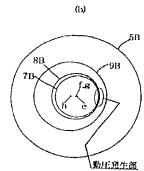


【図4】

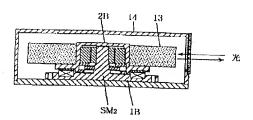




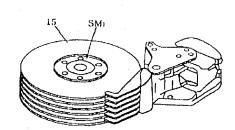




【図5】



【図6】



展して示すように、モータ回転時には、ラジ 可動部材8Aの中心とが移動してステータ4の に一致する。これは、ラジアル軸受固定部材7A こフジアル軸受可動部材8Aのいずれかに設けられた動 圧発生溝に取り込まれ昇圧する空気がラジアル軸受固定 部材7Aとラジアル軸受可動部材8Aの片当たりを解消 するギャップ(例えば0.01mm)を生ぜしめて、該 ギャップが生じる分だけラジアル軸受可動部材8Aが移 動してその中心とがステータ4の中心りに一致するから である。従って、モータ回転時には、スピンドル2Aの 回転中心がステータ4の中心りに対して同芯状態に維持 され、かつラジアル軸受可動部材8Aが片側に偏芯して ラジアル軸受固定部材7Aとの間に有効な空気動圧を発 生し、もってスピンドル2Aの振れ回りを回避でき非繰 り返し回転振れ(NRRO)が減少する。

【0011】スピンドル支持部材1Aのステータ収容孔をラジアル軸受固定部材収容孔に対して微小寸法(例えば5~10ミクロンmm)偏芯させ、さらにスピンドル支持部材1Aのリング磁石収容孔をラジアル軸受固定部材収容孔に対して微小寸法(例えば50~100ミクロンmm)偏芯させることは高度の加工技術を必要とし製作コストは高く付くので、スピンドル支持部材1Aのステータ収容孔をラジアル軸受固定部材収容孔に対して同芯として、スピンドル支持部材1Aのリング磁石収容孔をラジアル軸受固定部材収容孔に対して微小寸法偏芯させても実用上差し支えない。

【0012】図3は本願第三の発明のスピンドルモータ の第二の実施の形態を示しているとともに、本願第一及 び第二の発明のスピンドル装置の第二の実施の形態を示 している。このスピンドルモータSM2 は、円板状のス ピンドル支持部材1Bに、下端に鍔部2aを有しかつ上 面が閉じている概略キャップ形状に形成されたスピンド ル2Bが被さっており、さらにスピンドル支持部材1B の中央に立設された固定軸12が前記スピンドル2Bの 中心を通っており、さらに、スピンドル支持部材1Bの 上面にモータコイル5Bが設けられている一方、モータ コイル5Bに対向してスピンドル2Bの鍔部2aの下面 にモータ用永久磁石6 Bが設けられており、さらに、ス ピンドル2Bの内面上部にセラミック、その他の高耐摩 耗材料からなるラジアル軸受可動部材8Bが嵌着されて いる一方、これに対応するように、固定軸12の上部に セラミック、その他の高耐摩耗材料からなるラジアル軸 受固定部材7Bが設けられ、かつラジアル軸受固定部材 7 Bの外周面とラジアル軸受可動部材8 Bの内周面のい ずれか一方に図示しない動圧発生溝が刻設され、もって 気体ラジアル軸受が備えられており、さらに、スピンド ル2Bの内面下部にN極とS極が両端面に分極されたリ ング酸石10 B_1 、10 B_2 が間隔をあけて嵌着されて いる一方、リング磁石 $10\,\mathrm{B}_1$ 、 $10\,\mathrm{B}_2$ の間に対応す るように、固定軸 1 2の下部にリング磁石 9 Bが嵌着さ

れ、リング磁石 $10B_1$ または $10B_2$ のN極とリング磁石9BのN極が対向して磁力が反発し合っているとともにリング磁石 $10B_1$ または $10B_2$ のS極とリング磁石9BのS極が対向して磁力が反発し合っていて、もってスピンドル2Bがスピンドル支持部材1Bに対して浮くようになっている。

【0013】このスピンドルモータ SM_2 は、上記のよ うにスピンドル2Bに取り付けられたリング磁石10B $_1$ 、 $10B_2$ の磁力と、固定軸12に取り付けられたリ ング磁石9 Bの磁力が反発し合ってスピンドル2 Bがス ピンドル支持部材1Bに対して浮いて安定するので、気 体スラスト軸受は設けられていない。リング磁石9Bの 外径がリング磁石 $1 O B_1$ の内径よりも大きくリング磁 石9Bの上にリング磁石10B₁ がオーバーラップして いるのは、磁石同士の反発力を大きくしてスピンドル2 Bの浮上力を確保するためである。また、リング磁石1 OB₂の内径がリング磁石9Bの外径よりも僅かに大き くなっているのは、モータ用永久磁石6Bとラジアル軸 受可動部材8 Bとリング磁石10 B1、10 B2 を組み 付けたスピンドル2Bを、モータコイル5Bとリング磁 石9Bとラジアル軸受固定部材7Bを組み付けたスピン ドル支持部材1 Bに組付けられるようにするためであ

【0014】このスピンドルモータS M_2 は、スピンド ル2日に対し、モータ用永久磁石6日とラジアル軸受可 動部材8Bとリング磁石10 B_1 、10 B_2 が完全に同 芯状態に組付けられ、また、固定軸12に対し、ラジア ル軸受固定部材7Bが完全に同芯状態に組付けられてい る。固定軸12に対し、ゼータコイル5Bとリング磁石 9 Bは偏芯状態に設けられている。リング磁石9 Bが偏 芯状態に設けられる構成とは、リング磁石9 Bの内径が 外径に対して偏心しているか、固定軸12のリング磁石 9 Bが被嵌している箇所の軸径が固定軸 1 2 の中心線に 対して50~100ミクロンmm偏心しているかのどち らでも良い。固定軸12に対しリング磁石9Bが偏芯状 態に設けられていると、組付けられた状態では、モータ 停止時とモータ回転時のいかんにかかわらず、リング磁 石 $10B_1$ 、 $10B_2$ の磁力とリング磁石9Bの磁力が 反発して自動調芯作用を生起することにより、リング磁 石9Bの偏芯側にスピンドル2Bが偏心する。

【0015】図4(a)に誇張して示すように、モーター停止時には、ラジアル軸受固定部材7B(円は外径を示す)の中心をに対して、モータコイル5B(円はコイルの内外径の中間の径を示す)の中心 f とラジアル軸受可動部材8B(円は内径を示す)の中心のとリング磁石9Bの中心 hが片側に一軸線上に偏心している。中心を、f、g、hの位置関係を参照して説明する。ラジアル軸受固定部材7Bの中心をに対してリング磁石9Bの中心 hが50~100ミクロンmmと最も大きく偏心してい

る。この隔芯量は、リング磁石10 ${\sf B}_1$ 、10 ${\sf B}_2$ の磁

【特許請求の範囲】

【請求項1】 スピンドルが気体ラジアル軸受を介してスピンドル支持部材に支持されたスピンドル装置において、

N極と S極が両端面に分極された三つのリング磁石の中、二つのリング磁石がスピンドルまたはスピンドル支持部材のいずれか一方に間隔をあけて取り付られているとともに、残り一つのリング磁石が前記二つのリング磁石の中間に位置されてスピンドルまたはスピンドル支持部材のいずれか他方に取り付られ、スピンドルに取り付られたリング磁石とスピンドル支持部材に取り付られたリング磁石の反発により、スピンドルが浮く構成であることを特徴とするスピンドル装置。

【請求項2】 スピンドル支持部材に取り付られている リング磁石がスピンドル支持部材に取り付られているラ ジアル軸受固定部材に対して微小寸法偏芯していること を特徴とする「請求項1」記載のスピンドル装置。

【請求項3】 「請求項1」または「請求項2」に記載のスピンドル装置にモータが備えられていることを特徴とするスピンドルモータ。

【請求項4】 スピンドルの回転中心にスピンドルに取り付られたラジアル軸受可動部材の中心が一致していることを特徴とする「請求項3」に記載のスピンドルモータ。

【請求項5】 「請求項3」または「請求項4」のスピンドルモータのスピンドルに磁気ディスクあるいは光ディスク等の被回転体が取り付けられていることを特徴とするスピンドルモータを採用した回転体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、気体ラジアル軸受を備え気体スラスト軸受は不要なスピンドル装置、及びスピンドルが気体ラジアル軸受のギャップ寸法の範囲で片側に微小寸法偏芯して回転して軸の振れ回り(ホワール)を防止でき安定した回転を確保できるスピンドル装置、及び前記スピンドル装置にモータを備えたスピンドルモータ、及び前記スピンドルモータを採用した回転体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、気体動圧軸受式スピンドルモータを採用したレーザースキャナーやハードディスク駆動装置のテスト装置等において、スピンドルモータのスピンドルが固定軸に対して振れ回り(ホワール)を生じることにより非繰り返し回転振れ(NRRO)が生ずることが知られている。他方、スピンドル支持部材のスピンドルの支持中心に対してスピンドルの回転中心を微小寸法偏芯させると、気体ラジアル軸受のラジアル軸受固定部材とラジアル軸受可動部材との間の偏芯側に最小ギャップが生じかつそこに動圧が有効に発生し、偏芯の確保と動圧の発生によってスピンドルが固定軸に対して振れ回

り(ホワール)を回避でき非繰り返し回転振れ(NRR ○)が減少することが研究レベルにおいて知られてい る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、気体ラジアル軸受は、ラジアル軸受固定部材とラジアル軸受可動部材のいずれか一方に動圧発生溝を形成して空気の粘性を利用して空気を動圧発生溝内に誘導し昇圧することによりラジアル軸受固定部材でラジアル軸受可動部材を非接触で支持するものであり、このため、ラジアル軸受可動部材をラジアル軸受固定部材に対して微小寸法偏芯させる方法・手段は未だ提案されていない。

[0004]

【課題を解決するための手段】本願発明は、気体ラジアル軸受を備え気体スラスト軸受は不要なスピンドル装置を提供することにある。本願発明は、気体ラジアル軸受を備え気体スラスト軸受は不要でありスピンドルが気体ラジアル軸受のギャップ寸法の範囲で片側に微小寸法偏芯して回転して軸の振れ回り(ホワール)を防止でき安定した回転を確保できるスピンドル装置を提供することにある。本願発明は、前記スピンドルモータを提供することにある。本願発明は、前記スピンドルモータを採用した回転体装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本願第一の発明は、スピ ンドルが気体ラジアル軸受を介してスピンドル支持部材 に支持されたスピンドル装置において、N極とS極が両 端面に分極された三つのリング磁石の中、二つのリング 磁石がスピンドルまたはスピンドル支持部材のいずれか 一方に間隔をあけて取り付られているとともに、残り一 つのリング磁石が前記二つのリング磁石の中間に位置さ れてスピンドルまたはスピンドル支持部材のいずれか他 方に取り付られ、スピンドルに取り付られたリング磁石 とスピンドル支持部材に取り付られたリング磁石の反発 により、スピンドルが浮く構成であることを特徴とする スピンドル装置を提供するものである。本願第二の発明 は、スピンドル支持部材に取り付られているリング磁石 がスピンドル支持部材に取り付られているラジアル軸受 固定部材に対して微小寸法偏芯していることを特徴とす るスピンドル装置を提供するものである。本願第三の発 明は、前記第一または第二の発明のスピンドル装置にモ ータが備えられていることを特徴とするスピンドルモー 夕を提供するものである。本願第四の発明は、スピンド ルの中心にスピンドルに取り付られているラジアル軸受 可動部材の回転中心が一致していることを特徴とするス ピンドルモータを提供するものである。本願第五の発明 は、前記第三または第四の発明のスピンドルモータのス ピンドルに磁気ディスクあるいは光ディスク等の被回転 体が取り付けられていることを特徴とするスピンドルモ